

INDUSTRIA

Semiconductores

Control de partículas, contaminación molecular y descarga electrostática en fabricación de semiconductores.



FICHA TÉCNICA POR NÚMERO DE PARTE



REFERENCIAS DE NORMA



CONSUMO RECURRENTE

En una fab, el defecto que mata un chip mide una fracción de la geometría que se está imprimiendo. Por eso el control de contaminación en semiconductores no se parece al de ninguna otra industria: no basta con que el aire esté limpio, hay que controlar también lo que sueltan las superficies, los guantes y el propio paño con el que se limpia.

PRODUCTOS PARA ESTA INDUSTRIA



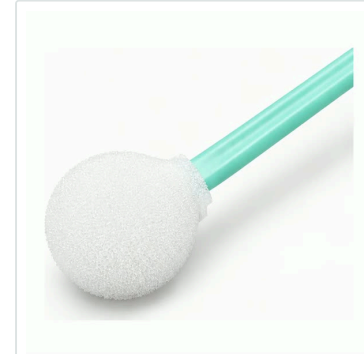
Wipe de Poliéster VANTERIS 9 × 9 in
VTN-WP-PES-LS-99
 9 × 9 in (228.6 × 228.6 mm)



Tapete Autoadhesivo VANTERIS 24 × 36 in, Azul
VTN-MAT-PE-STK-2436-BLU
 24 × 36 in



Cofia Tipo Escafandra VANTERIS 40 × 42 cm, Blanca
VTN-AP-PP-NH-UNI-WHT
 40 × 42 cm



Foam Swab VANTERIS cabeza circular grande
VTN-SW-PU-LC-132
 132.2 mm

RETOS TÍPICOS

- Partículas por debajo de la geometría de proceso
- Contaminación molecular en fotolitografía
- Descarga electrostática en wafer y dispositivo
- Compatibilidad del consumible con solventes de proceso

NORMAS DE REFERENCIA

ISO 14644-1

Clasifica la limpieza del aire por concentración de partículas (clases ISO 1 a 9).

ISO 14644-9

Clasifica la limpieza de superficies por concentración de partículas.

IEST-RP-CC004

Método para evaluar paños de limpieza de cuarto limpio.

ANSI/ESD S20.20

Requisitos de un programa de control de descarga electrostática.

VANTERIS

ventas@vanteris.mx

Francisco Márquez 16138, int. BA13, Valle Vista 1ra Secc.

22456 Tijuana, B.C., México

Lunes a viernes, 08:00 – 17:00

Artículo técnico y catálogo

